

MBSC棟内研究装置・設備機器担当者										
【装置・設備は、担当者に連絡の上、必ず装置講習を受講してから使用すること】										
装置名	型式	メーカー	設置部屋	担当教職員	内線	E-mailアドレス				
クリーンルーム	AIC-9500CS	アッペ科学株式会社	1階 クリーンルーム	CR管理室 金田祥平 鈴木健司 相川慎也	3663 3508 3660 3431	wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp kaneda@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp aikawa@cc.kogakuin.ac.jp				
S深掘りエンテング装置	MUC-21 ASE-SRE	住友精密工業株式会社								
接触角計	Phenix300	メイフオース株式会社								
金属顕微鏡	BX41M	オリンパス株式会社								
金属顕微鏡	BX51-33MU	オリンパス株式会社								
スハタ装置(一元)	L-210S-FH	キャンアネルバ株式会社								
スハタ装置(三元)	L-332S-FH	キャンアネルバ株式会社								
高速型真空蒸着装置	VPC-410	アルバック機工株式会社								
スピコーター①	1H-DX2	ミカサ株式会社								
スピコーター②	MS-A150	ミカサ株式会社								
スピコーター③	MS-A190	ミカサ株式会社								
片面マスクアライナー	M-1S	ミカサ株式会社								
両面マスクアライナー	PEM-800	ユニオン光学株式会社								
レーザー直接描画装置	DDB-201	ネオアーク株式会社								
コンパクトエッチャー	FA-1	株式会社サムコンターナショナル								
RIE	RIE-10NR	株式会社サムコンターナショナル								
オープン	DX-401	ヤマト科学株式会社								
枚葉式スピンドライヤー	SF-250-HDN-ARM1	ジャパンクリイト株式会社								
膜厚計	F20	松下テクノレーディング株式会社								
EDX WETSEM	JSM-6360LA	日本電子株式会社								
形状測定レーザーマイクロスコープ (レーザー顕微鏡)	VK-X200	株式会社キーエンス								
3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	VE-8800S	株式会社キーエンス								
ダイシングマシン	DAD-522	ディスコ株式会社								
ブローヤ	PC-10	ナリシゲ								
小型真空蒸着装置	VWR-400M	アルバック機工株式会社								
超純水製造装置	Milli-Q Element A-10 Elix 3	日本ミリポア株式会社								
ECRイオンシャワー装置	EIS-200ER	株式会社エリオニクス								
真空隔極接合装置	HORIVAC300S	堀口鉄工所								
引張強度試験機	HEIDEN type 18L	新東科学株式会社								
接触式表面形状測定装置	Dektak XT-E	Bruker Corporation								
4探針抵抗測定器	Model sigma-5+	エスビエス株式会社								
クリーンルーム	-	日本エアーテック株式会社					3階 クリーンルーム	CR管理室 金田祥平 鈴木健司	3663 3508 3660	wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp kaneda@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp
フェムト秒レーザー	IFRIT	サイバーレーザー株式会社								
拡散接合装置	NP-15G-S	ネムス株式会社								
電子ビーム蒸着装置	JBS-Z0501EVC	日本電子株式会社	CR管理室	金田祥平 鈴木健司 相川慎也	3663 3508 3660	wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp kaneda@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp				
高速度カメラ	FASTCAM-MAX120K CmoDel-1	株式会社フォトロン								
赤外線放射温度計	A6753sc	日本バーズ株式会社	16-226	大竹 浩晴	3615	ohtake@cc.kogakuin.ac.jp				
パルレンコーティング装置	PDS-2010	Speciality coating systems	16-221	金田 祥平 鈴木 健司	3508 3660	kaneda@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp				
半導体レーザー (3W)	VD-IVA	漢和商事株式会社	16-231							
粘弾性測定装置	ARES-G2	ターエイ・インスツルメンタル株式会社	16-226	西谷 要介	3516	at13152@ns.kogakuin.ac.jp				
マイクロフォーカス線CT装置	ScanXmateE-090	コムスキャンテクノ	16-229							
EDX WETSEM	JSM-6380LA	日本電子株式会社	16-230	CR管理室 金田祥平 鈴木健司	3663 3508 3660	wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp kaneda@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp				
X線回折装置	RINT2200VK/PC	株式会社リガク								
X線回折装置	SmertLab	株式会社リガク	16-231	相川 慎也	3431	aikawa@cc.kogakuin.ac.jp				
集束イオンビーム装置(FIB)	FB-2100	株式会社日立ハイテクノロジーズ								
YAGレーザー(バルス)	CYQ-T050MWS	ネオアーク株式会社	16-231	阿相 英孝	3607	aso@cc.kogakuin.ac.jp				
ラマン顕微鏡	XploRA	株式会社堀場製作所								
三次元モリフグシステム	VG Studio Point Master	日本ビジュアルサイエンス株式会社								
光造形装置	URM-HP301	株式会社ユニラビッド								
光造形用CAD	SolidWorks	キャンシシステムレーディング								
リアルタイムPCR	LightCycler480 System II	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	細胞培養室 (16-325)	金田 祥平	3508	kaneda@cc.kogakuin.ac.jp				
吸光マイクロプレートリーダー	Multiscan FC	Thermo Scientific								
細胞培養システム(クリーンベンチ)	MCO-175.MCV-B161F	三洋電機								
冷却遠心機	kubotal-2800	久保田商事株式会社								
乾熱滅菌器	NDS-510	EVELA東京理化学器械株式会社								
オートクレーブ滅菌装置	KTS-3085	アルプ株式会社								
オートクレーブ滅菌装置	KT-2322	アルプ株式会社								
臨界点乾燥装置	JCPD-5	日本電子株式会社								
顕光・位相差インキュベーター顕微鏡	LCV110-SK	オリンパス株式会社								
ミクロトーム	リターム REM-710	大和光機工業株式会社								
マイクロスコープ	VHX-100	株式会社キーエンス	応用実験室 (16-326)	CR管理室 相川 慎也	3663 3661	wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp aikawa@cc.kogakuin.ac.jp				
マイクロスコープ	VHX-1000	株式会社キーエンス								
ナインプリント装置	obducat									
超深度カラー3D形状測定顕微鏡 (レーザー顕微鏡)	VK-9500	株式会社キーエンス								
超微小押込み硬さ試験機①	ENT-1100a	株式会社エリオニクス								
超微小押込み硬さ試験機②	ENT-1100a	株式会社エリオニクス								
走査型焦点レーザー顕微鏡	OLS-3000LS	オリンパス株式会社								
熱分析装置(TG-DTA)	Thermo plus EVO TG 8120	株式会社リガク								
ワンショット3D形状測定機	VR-3200	株式会社キーエンス								
PEN型大気圧プラズマ	P500-SM	株式会社魁半導体								
3D加工装置	AGLISTA-3000	株式会社キーエンス					ヒューマンインタ フェース研究室	見崎 大悟	2452	misaki@cc.kogakuin.ac.jp
レーザードップラー流速計	SmartLDV II システム	日本カ/マックス株式会社					流体機械研究室	佐藤 光太郎	3581	at12164@ns.kogakuin.ac.jp
熱線流速計	カノマックスHW-100 4CHシステム	日本カ/マックス株式会社								
流体力計測装置	LMC-61296	日章電機株式会社								